Особенности структурных напряжений в нитевидных нанокристаллах InGaN/GaN

© И.П. Сошников^{1,2,3}, К.П. Котляр^{1,4}, Р.Р. Резник⁵, В.О. Гридчин^{1,4}, В.В. Лендяшова^{1,2}, А.В. Вершинин¹, В.В. Лысак⁵, Д.А. Кириленко², Н.А. Берт², Г.Э. Цырлин^{1,2,3}

¹ Санкт-Петербургский Академический университет им. Ж.И. Алфёрова Российской академии наук,

² Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

³ Институт аналитического приборостроения Российской академии наук,

198095 Санкт-Петербург, Россия

⁴ Санкт-Петербургский государственный университет,

199034 Санкт-Петербург, Россия

⁵ Университет ИТМО,

197101 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ipsosh@beam.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 12 апреля 2021 г. В окончательной редакции 19 апреля 2021 г. Принята к публикации 19 апреля 2021 г.

Представлено экспериментальное исследование, направленное на развитие метода спонтанного синтеза нитевидных нанокристаллов InGaN/GaN радиальной гетероструктуры при молекулярно-пучковой эпитаксии. Методами электронной микроскопии показано, что при содержании In x = 0.4 и 0.04 в ядре и оболочке и размерах ядра может образоваться клиновидная трещина. На основе модели внутренних структурных напряжений предложена формула, позволяющая оценить критические размеры и состав для образования трещин в нитевидных нанокристаллах. Сопоставление оценок и экспериментальных данных морфологии дает хорошее согласие между собой.

Ключевые слова: нитевидные нанокристаллы, молекулярно-пучковая эпитаксия, осевые гетероструктуры, напряженные гетероструктуры, нитрид индия, нитрид галлия.

DOI: 10.21883/FTP.2021.09.51295.25

1. Введение

Радиальные гетероструктуры (РГС) на основе нитевидных нанокристаллов (ННК) III-N материалов представляют особый интерес в связи с перспективами их приложений в оптоэлектронике, пьезотронике, а также для генерации водорода при фоторазложении воды [1-3]. В отличие от аксиальных гетероструктур на основе ННК III-N материалов формирование радиальной гетероструктуры типа "ядро-оболочка" подразумевает рост материала на неполярных и полуполярных кристаллографических плоскостях ННК. Такой дизайн гетероструктуры позволяет минимизировать поляризационные эффекты, характерные для аксиальных гетероструктур [4,5]. Большое отношение площади поверхности к объему ННК определяет перспективы их применения в областях, где главную роль играют поверхностные эффекты [6]. Также увеличение площади гетероперехода существенно увеличивает фотопоглощение или эмиссию света в сравнении с аксиальными гетероструктурами на основе ННК [7].

Развитие исследований в указанном направлении до последнего времени было ограничено вследствие проблем с синтезом структур. Как правило, синтез РГС ННК проводился по методике, включающей рост "ядра"

и последующее наращивание "оболочки" [8]. Несмотря на контролируемое формирование такой гетероструктуры, существует проблема синтеза наноструктур с высоким составом по In порядка 30–50% [9,10], что существенно сужает спектральный диапазон излучения таких структур.

Другим возможным подходом к формированию радиальных гетероструктур является спонтанное формирование InGaN/GaN РГС на основе ННК. В [2,10] было показано, что при синтезе InGaN ННК методом газофазной эпитаксии возможно спонтанное формирование InGaN/GaN радиальной гетероструктуры с составом по In \sim 30%. Представленная работа направлена на развитие метода спонтанного синтеза ННК InGaN/GaN радиальной гетероструктуры при молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ). Особое внимание уделено особенностям морфологических и структурных свойств таких ННК.

2. Экспериментальные методы

Синтез InGaN ННК проводился в установке МПЭ Riber Compact 12, оснащенной плазменным источником азота Addon RF-N 600. Методика роста ННК описана в работах [11,12]. На первом этапе загруженные в ростовую камеру подложки Si(111) *р*-типа проводимо-

¹⁹⁴⁰²¹ Санкт-Петербург, Россия

сти нагревались до 950°С для удаления слоя естественного оксида. После этого температуру подложки понижали до 660°С и инициировали источник плазмы азота. После стабилизации температуры подложки одновременно открывались заслонки источников галлия и индия. Потоки галлия и индия при синтезе InGaNнаноструктур были равны между собой и эквивалентны давлению $1 \cdot 10^{-7}$ Торр. Поток активированного плазмой азота соответствовал давлению $1 \cdot 10^{-6}$ Торр, расход азота $F_{N2} = 0.4$ см³/мин, мощность плазменного разряда составила 400 Вт. Время синтеза составляло 21 ч. По окончании ростового процесса образцы охлаждались до комнатной температуры и выгружались из установки МПЭ для изучения морфологических и структурных свойств.

Исследование морфологии и кристаллической структуры ННК проводилось методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии (РЭМ и ПЭМ) на микроскопах Supra 25 (C.Zeiss) и JEM-2100F (Jeol), оснащенном приставкой для энергодисперсионного элементного анализа Quantax EDX XFlash 6 (Bruker).

3. Результаты и обсуждение

На рис. 1 представлены типичные РЭМ-изображения InGaN HHK, выращенных при температуре подложки $T_s = 660^{\circ}$ С. Высота массива ННК составила 2.2 мкм, со средней плотностью массива $7 \cdot 10^9$ см⁻². Характерные латеральные размеры ННК вдоль оси роста, совпадающей с кристаллографической осью [0001] в нитридах, составляют от 120 до 40 нм у вершины. В сечении ННК имеют форму неправильных шестигранников (рис. 1, *b*).



Рис. 1. Типичные РЭМ-изображения в геометрии поперечное сечение (a) и вид сверху (b) массива InGaN нитевидных нанокристаллов, синтезированных на Si подложке. Стрелкой указана трещина в ННК.



Рис. 2. Типичные ПЭМ-изображения вершин InGaN ННК без трещины (*a*) и с трещиной (*b*).



Рис. 3. Энергодисперсионный спектр микроанализа от "ядра" ННК.

Морфология ряда ННК содержит "клиновидные трещины", что свидетельствует о наличии структурных напряжений внутри ННК. В большинстве случаев трещины начинаются в области центра ННК и раскрываются в направлении к грани, существенно реже — к ребру. Угол раствора клина составляет от 7 до 25°, а доля нитевидных нанокристаллов с трещинами достигает 15% от общего числа ННК.

На рис. 2, *a*, *b* представлены ПЭМ-изображения сечения InGaN ННК с трещиной и без. По данным ПЭМ, в результате синтеза формируются ННК с огранкой по плоскостям (11 $\overline{2}0$) в виде неправильного шестигранника (рис. 2, *a*). В центральной области ННК (ядро — центральная область ННК вдоль оси роста) наблюдается контраст изображений, связанный с повышенным содержанием In. Содержание In во внешней области и ядре ННК, по данным ПЭМ энергодисперсионного анализа, составляет порядка x = 0.03 и 0.4 соответственно (рис. 3). Характерные размеры ядра составляют порядка от 20 до 50 нм в поперечном сечении, оно также огранено плоскостями (11 $\overline{2}0$).

Формирование структуры типа "ядро InGaN-оболочка GaN" происходит спонтанно в теле ННК. Теоретическое обоснование механизма формирования такой структуры выходит за рамки настоящего исследования и будет



Рис. 4. a — зависимость геометрических параметров и состава структуры "ядро InGaN — оболочка GaN": I — ННК без трещин, 2 — с трещиной. Стрелкой отмечен критический размер ядра ННК. b — зависимость угла раскрытия трещины от контраста состава "ядро-оболочка". Горизонтальные прямые соответствуют оценкам тангенса угла раскрытия при значениях параметра релаксации напряжений f = 1, 3 и 2.

изложено в отдельной работе. На рис. 4, а показана диаграмма распределения диаметр "ядра"-контраст состава "ядро InGaN-оболочка GaN" по In. Видно, что при величине диаметра ядра > 34 нм наблюдается образование клиновидных трещин. В то же время при размерах ядра < 34 нм трещин не наблюдается.

Образование трещин является пластической деформацией разрыва в "оболочке" структуры. Предельный радиус ядра ННК для образования пластической деформации может быть определен в рамках классической модели напряжений "стержень в оболочке" для упругих и пластических деформаций [13–22]:

$$R \approx \frac{a_c^2}{2(a_c - a_s)(1 + \nu)},$$

где a_c и a_s — параметры решетки ядра и оболочки ($a_c = x_c \cdot a_{\text{InN}} + (1 - x_c) \cdot a_{\text{GaN}}$ и $a_s = x_s \cdot a_{\text{InN}}$ + $(1 - x_s) \cdot a_{\text{GaN}}$, $a_{\text{InN}} = 0.355$, $a_{\text{GaN}} = 0.319$ нм [20]; x_c и x_s — содержание индия в ядре и оболочке структуры; $v = C_{12}/(C_{11} + C_{12})$ — параметр пуассоновского сжатия (в случае InN и GaN $v \approx 0.3$ [23,24]). Оценка характерных размеров для пластической деформации в структуре "стержень в оболочке" дает величину 35 ± 3 нм при значениях состава $x_c \approx 0.37$ и $x_s \approx 0.03$. Сопоставление экспериментальных результатов и теоретической оценки (рис. 4, a) показывает хорошее согласие между собой.

Характерные размеры трещины можно оценить по формуле

$$\operatorname{tg} \alpha \simeq \frac{2f(a_c - a_s)}{a_c},$$

где tg α — тангенс угла раствора трещины, a_c и a_s — параметры решетки ядра и оболочки, f — параметр релаксации напряжений. В [23,24] показано, что величина параметра f может изменяться в пределах от

 $f \sim (1 + \nu)/(1 - \nu)$ до $f \sim (1 + \nu)$, где ν — параметр пуассоновского сжатия.

Сопоставление полученной экспериментальной зависимости тангенса угла раскрытия трещины от структурных напряжений ($u \sim \Delta x = x_c - x_s$) с теоретической оценкой приведено на рис. 4, b. Видно, что полученные экспериментальные данные укладываются в области между прямых, соответствующих верхней и нижней границам параметра релаксации напряжений f. Отклоняющаяся точка соответствует результату выхода трещины на ребро и должна оцениваться с параметрами для образования трещины в направлении $\langle 1\bar{1}00 \rangle$.

4. Заключение

Таким образом, в работе продемонстрировано образование ННК типа "ядро InGaN-оболочка GaN" гетероструктуры, которая является самоорганизующейся радиальной гетероструктурой и может иметь широкое применение в полупроводниковой оптоэлектронике. На основе модели внутренних структурных напряжений предложена формула, позволяющая оценить критические размеры и состав для образования трещин в ННК. Сопоставление оценок и экспериментальных данных морфологии дает хорошее согласие между собой.

Финансирование работы

Работа проводилась при поддержке РФФИ (проекты 18-07-01364 и 19-32-90156) и Министерства науки и высшего образования в части государственного задания № 0791-2020-0003. Исследования методами просвечивающей электронной микроскопии выполнялись с использованием оборудования Федерального объединенного исследовательского центра "Материаловедение и характеристика в передовых технологиях" (Физикотехнический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия).

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] S. Li, A. Waag. J. Appl. Phys., 111, 071101 (2012).
- [2] Q. Luo, R. Yuan, Y.-L. Hu, D. Wang. Appl. Surf. Sci., 537, 147930 (2021).
- [3] A. Zhang, G. Zheng, C.M. Lieber. Nanowires Building Blocks for Nanoscience and Nanotechnology (Springer NanoScience and Technology, 2016).
- [4] S.R. Routray, T.R. Lenka. Micro-Nano Lett., **12** (12), 924 (2017).
- [5] M. Monavarian, A. Rashidi, D. Feezell. Phys. Status Solidi A, 216, 1800628 (2019).
- [6] X. Chen, Cell K.Y. Wong, C.A. Yuan, G. Zhang. Sensors and Actuators B: Chemical, 177, 178, (2013).
- [7] Y.-L. Tsai, K.-Y. Lai, M.-J. Lee, Y.-K. Liao, B.S. Ooi, H.-C. Kuo, J.-H. He. Progr. Quant. Electron., 49, 1 (2016).
- [8] V.G. Dubrovskii. Nucleation Theory and Growth of Nanostructures (Springer Verlag, Berlin- Heidelberg, 2014).
- [9] E. Roche, Y. André, G. Avit, C. Bougerol, D. Castelluci, F. Réveret, E. Gil, F. Médard, J. Leymarie, T. Jean, V.G. Dubrovskii, A. Trassoudaine. Nanotechnology, 29, 465602 (2018).
- [10] Q.Y. Soundararajah, R.F. Webster, I.J. Griffiths, S.V. Novikov, C.T. Foxon, D. Cherns. Nanotechnology, 29, 405706 (2018).
- [11] V.O. Gridchin, K.P. Kotlyar, R.R. Reznik, D.S. Shevchuk, D.A. Kirilenko, N.A. Bert, I.P. Soshnikov, G.E. Cirlin. J. Phys.: Conf. Ser., 1482, 01201 (2020).
- [12] R.R. Reznik, V.O. Gridchin, K.P. Kotlyar, N.V. Kryzhanovskaya, S.V. Morozov, G.E. Cirlin. Semiconductors, 54 (9), 884 (2020).
- [13] С.П. Тимошенко. Сопротивление материалов (М., Наука, 1965) т. 2, гл 6.
- [14] M.V. Nazarenko, N.V. Sibirev, Kar Wei Ng, Fan Ren, Wai Son Ko, V.G. Dubrovskii, Connie Chang-Hasnain. J. Appl. Phys., 113, 104311 (2013).
- [15] М.Ю. Гуткин, И.А. Овидько. Дефекты и механизмы прочности в наноструктурных и некристаллических материалах (СПб., Янус, 2000).
- [16] И.А. Овидько, А.Г. Шейнерман. Наномеханика квантовых точек и проволок (СПб., Янус, 2004) гл. 2 и 5.
- [17] F. Glas. Phys. Rev. B, 90, 125406 (2014).
- [18] J.W. Matthews, A.E. Blakeslee. J. Cryst. Growth, 27, 118 (1974).
- [19] G. Kastner. Phys. Status Solidi A, 195 (2), 367 (2003).
- [20] E. Bellet-Amalric, C. Adelmann, E. Sarigiannidou, J.L. Rouvière, G. Feuillet, E. Monroy, B. Daudin. J. Appl. Phys., 95, 1127 (2004).
- [21] M. De la Mata, C. Magén, P. Caroff, J. Arbiol. Nano Letters, 14 (11), 6614 (2014).

- [22] O. Madelung, U. Rössler, M. Schulz. New Data and Updates for IV-IV, III-V, II-VI and I-VII Compounds, their Mixed Crystals and Diluted Magnetic Semiconductors, Landolt-Börnstein — Group III Condensed Matter (Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 2011) v. 44D, p. 517.
- [23] J.W. Cahn. Acta Met., 9 (9), 795 (1961).
- [24] Springer Handbook of Crystal Growth, ed. by G. Dhanaraj, K. Byrappa, V. Prasad, M. Dudley (Springer Verlag, Berlin– Heidelberg, 2010).

Редактор Г.А. Оганесян

Specifics of the stress in InGaN/GaN nanowires

I.P. Soshnikov^{1,2,3}, K.P. Kotlyar^{1,4}, R.R. Reznik⁵, V.O. Gridchin^{1,4}, V.V. Lendyashova^{1,2}, A.V. Vershinin¹, V.V. Lysak², D.A. Kirilenko², N.A. Bert², G.E. Cirlin^{1,3,5}

¹ Alferov University,
194021 St. Petersburg, Russia
² loffe Institute,
194021 St. Petersburg, Russia
³ Institute for Analytical Instrumentation of the Russian Academy of Sciences,
190103 St. Petersburg, Russia
⁴ St Petersburg State University,
199034 St. Petersburg, Russia
⁵ ITMO University,

197101 St. Petersburg, Russia

Abstract The spontaneous synthesis of InGaN/GaN nanowires of core-shell heterostructure using molecular beam epitaxy is investigated in the work. It is shown by electron microscopy that a wedge-shaped crack can form at In content x = 0.4 and 0.04 in the core and shell correspondent. Based on the model of internal structural stresses, a formula is proposed for estimation of the critical size and composition for the formation of cracks in NWs. The estimations and experimental data of morphology agree with each other.